

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шевчик Андрей Павлович
Должность: Ректор
Дата подписания: 12.09.2022 13:37:29
Уникальный программный ключ:
476b4264da36714552dc83748d2961662babc012

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) □
Инженерно-технологический

УТВЕРЖДАЮ

Ректор _____ Шевчик А.П.
"___" _____ 20__ г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе специалитета

15.05.01

Специальность: Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация: специализация N 20 "Проектирование технологических комплексов производства энергонасыщенных материалов":

Кафедра: Химической энергетики

Факультет: Инженерно-технологический

Квалификация: инженер

Год начала подготовки (по учебному плану) 2020

Форма обучения: Очная

Образовательный стандарт (ФГОС) № 1343 от 28.06.2016

Срок получения образования: 5 л. 6 м.

Виды профессиональной деятельности

производственно-технологическая

научно-исследовательская

проектно-конструкторская

СОГЛАСОВАНО

Проректор по УиМР _____ / Пекаревский Б.В./

Начальник УМУ _____ / Денисенко С.Н./

Декан инженерно-технологического
факультета _____ / Мазур А.С./

Зав.кафедрой ХЭ _____ / Мазур А.С./

Руководитель направления _____ / Незамаев Н.А./

+	Б1.В.13	Применение CAD/CAM/CAE систем при проектировании оборудования	7					4	4	144	144	78	72	30	36					4							18	Оборудования и робототехники переработки пластмасс			
+	Б1.В.14	Физическая культура и спорт (элективные курсы)		1234567						328	328	328	328														21	Физического воспитания			
+	Б1.В.ДВ.01	Дисциплины по выбору 1	5					4	4	144	144	78	72	39	27					4											
+	Б1.В.ДВ.01.01	Общая химическая технология	5					4	4	144	144	78	72	39	27					4							32	Общей химической технологии и катализа			
-	Б1.В.ДВ.01.02	Органическая химия	5					4	4	144	144	78	72	39	27					4							22	Органической химии			
+	Б1.В.ДВ.02	Дисциплины по выбору 2	7					4	4	144	144	60	54	57	27						4										
+	Б1.В.ДВ.02.01	Информационные технологии в проектировании	7					4	4	144	144	60	54	57	27						4						13	Мехатронных технологических комплексов			
-	Б1.В.ДВ.02.02	Основы компьютерной графики	7					4	4	144	144	60	54	57	27						4						13	Мехатронных технологических комплексов			
+	Б1.В.ДВ.03	Дисциплины по выбору 3	5					6	6	216	216	94	90	95	27					6											
+	Б1.В.ДВ.03.01	Использование программного обеспечения для расчета оборудования	5					6	6	216	216	94	90	95	27					6							13	Мехатронных технологических комплексов			
-	Б1.В.ДВ.03.02	Современные методы расчета машин и аппаратов	5					6	6	216	216	94	90	95	27					6							13	Мехатронных технологических комплексов			
+	Б1.В.ДВ.04	Дисциплины по выбору 4	9					4	4	144	144	54	48	63	27							4									
+	Б1.В.ДВ.04.01	Жизненный цикл оборудования энергонасыщенных материалов	9					4	4	144	144	54	48	63	27						4						13	Мехатронных технологических комплексов			
-	Б1.В.ДВ.04.02	Жизненный цикл оборудования химических производств	9					4	4	144	144	54	48	63	27						4						13	Мехатронных технологических комплексов			
+	Б1.В.ДВ.05	Дисциплины по выбору 5	8					6	6	216	216	104	96	85	27						6										
+	Б1.В.ДВ.05.01	Химические процессы и реакторы	8					6	6	216	216	104	96	85	27						6						13	Мехатронных технологических комплексов			
-	Б1.В.ДВ.05.02	Аппараты с механическими перемешивающими устройствами для проведения физических процессов	8					6	6	216	216	104	96	85	27						6						13	Мехатронных технологических комплексов			
Блок 2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)								39	39	1404	1404	468		936						3	6	9	21								
Базовая часть								39	39	1404	1404	468		936							3	6	9	21							
+	Б2.Б.01	Учебная практика						3	3	108	108	36		72						3											
+	Б2.Б.01.01(У)	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности						3	3	108	108	36		72						3							13	Мехатронных технологических комплексов			
+	Б2.Б.02	Производственная практика						36	36	1296	1296	432		864							6		9	21							
+	Б2.Б.02.01(П)	Технологическая практика						3	3	108	108	36		72							3						13	Мехатронных технологических комплексов			
+	Б2.Б.02.02(Н)	Научно-исследовательская работа						3	3	108	108	36		72							3						13	Мехатронных технологических комплексов			
+	Б2.Б.02.03(П)	Конструкторская практика						9	9	324	324	108		216									9				13	Мехатронных технологических комплексов			
+	Б2.Б.02.04(П)	Преддипломная практика						21	21	756	756	252		504										21			13	Мехатронных технологических комплексов			
Блок 3.Государственная итоговая аттестация								9	9	324	324	35		289											9						
Базовая часть								9	9	324	324	35		289												9					
+	Б3.Б.01	Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР						9	9	324	324	35		289										9			13	Мехатронных технологических комплексов			
ФТД.Факультативы								3	3	108	108	58	54	50						1	2										
Вариативная часть								3	3	108	108	58	54	50						1	2										
+	ФТД.В.01	Культурология					5	1	1	36	36	18	18	18						1							10	Истории Отечества, науки и культуры			
+	ФТД.В.02	Технологические схемы и компоновка оборудования					6	2	2	72	72	40	36	32						2							5	Инженерного проектирования			